

スパッタリング装置

【メーカー】 島津エミット (株)

【型番】 HSR-351SP

【設置場所】 理工学部5号館南棟1階111

【仕様】

- ・2インチターゲット (3基)
- ・高周波電源: 1台
- ・基板サイズ: $\phi 150$ mm (回転時)
- ・基板回転: 20 rpm (MAX)
- ・基板加熱: 300°C
- ・排気: 油拡散ポンプ + 油回転ポンプ
- ・ガス: Ar、O₂



機器の説明

主に金属 (Cu など)、酸化物 (Cu₂O など) の堆積に使用。

【備考欄】

設備・機器の管理者に直接お問い合わせが必要です。

管理者: 田中 徹

管理者所属: 理工学部電気電子工学部門

Email: ttanaka[[@](mailto:ttanaka@cc.saga-u.ac.jp)]cc.saga-u.ac.jp

内線: 8872